

ПЛАЗМОВИЙ РОЗМІТНИК «ARCWRITER»

Призначення. Застосовується на машинах термічного різання для нанесення дрібної, глибокої й крапкової розмітки на металеву поверхню.

Галузь використання – машинобудування.

Опис. У розмічальний пристрій входить джерело живлення, маркувальний плазмотрон, кабелі для підведення живлення. Дрібне маркування легко усувається в процесі подальшої обробки деталі: ширина лінії розмітки – 0,5–1,0 мм; глибина розмітки – 0,03; швидкість розмітки – 3–7 мм. Для глибокого маркування розміри глибини розмітки задаються настроюванням сили струму типом газу, що подається на розмічальну голівку: ширина лінії розмітки – 0,5–1,0 мм; глибина розмітки – 0,08–0,25; швидкість розмітки – 3–7 мм. Крапкова розмітка задається зміною сили струму, типом газу й часом: діаметр крапок – 1,0–1,5 мм; глибина – 0,5–1,0 мм; час розмітки крапки – менше 1 с. Вимоги до газів: плазмовий газ – сухе повітря або Н5(5-відсотковий водень і 95-відсотковий аргон); захисний газ – повітря. Якість газу: повітря – сухе, очищене від масла; тиск газів: плазмовий газ – 6,9 бар; споживання – 28 л/хв; захисний газ – 6,9 бар; споживання – 141 л/хв.

Технічна характеристика

Регулювання вихідного струму	4–19 А
Напруга живлення	3x400 В, 50 Гц
Габаритні розміри, мм:	
ширина	321
висота	475
довжина	716
Вага	55 кг

Переваги:

Відмінні риси:

- висока швидкість розмітки на листах вуглецевої сталі, нержавіючій сталі, алюмінієвих сплавах і інших металах – до 7 м/хв;
- маркування деталей, нанесення написів, розмітки під подальше свердління, зварювання тощо;
- зміна напруги дає змогу регулювати ширину й глибину ліній маркування і крапок;
- виконання процесу маркування не викликає радіоперешкод і не впливає на роботу ЧПУ машини;
- можливість нанесення розмітки на вологу або масляну поверхню;
- 100-відсотковий робочий цикл;
- гарантія: два роки – на джерело живлення; один рік – на маркувальний плазмотрон.

Стадія готовності. Упроваджено у виробництво.

Пропозиції щодо співпраці. Реалізація готової продукції.



НОВЕ В НАУЦІ ТА ТЕХНІЦІ

Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном у 2010 р.*

№ п/п	Термін і місце проведення**	Назва заходу	Організатор
Березень			
1	01-14 Кемерово Росія	Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Освіта, наука, інновації – внесок молодих дослідників»	Кемеровський державний університет rector@kemsu.ru www.kemsu.ru
2	21.02 01.03 Железногорськ Росія	IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспектива»	Красноярський державний педагогічний університет http://conf.fkgpu.ru
3	01.03 02.03 Москва Росія	Всеросійський конгрес «Правове регулювання інноваційної діяльності – 2010»	Конгрес-центр готелю «Космос» www.asergroup.ru

* З більш детальною інформацією про симпозиуми, конференції, семінари тощо, що заплановані до проведення в Україні у 2010 році можна ознайомитися, підписавшись на Інформаційний бюлетень УкрІНТЕІ «План проведення наукових, науково-технічних симпозиумів, з'їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні» (4 випуски на рік) – http://www.uinpei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=117.

** Увага! Для уточнення термінів проведення виставок, звертайтеся на сайти організаторів виставок.